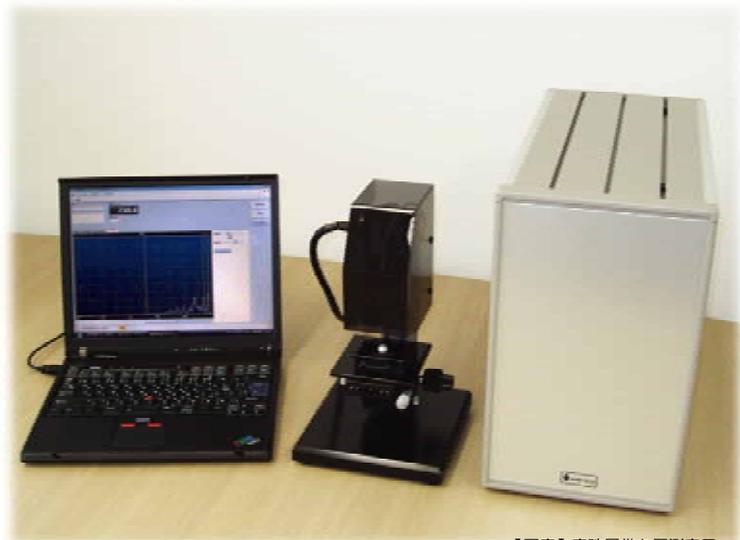
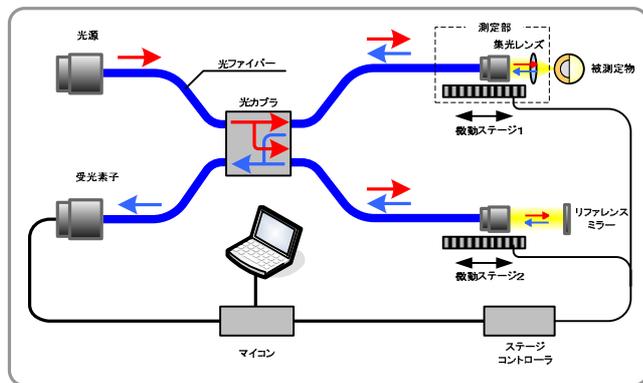


膜厚測定器

光ファイバー化光干渉膜厚測定器



【写真】真珠層巻き厚測定用



基本構成図
(真珠層測定用)

>> 概要

本膜厚測定器は、被測定物の膜厚を非接触、非破壊で測定することができます。レーザー干渉計とスーパーミネッセントダイオード(SLD)*1を使い、従来の光干渉計の空間伝搬路を光ファイバーで構成すること(特許3542346)によって、構成部品のコンパクト化と、周囲環境からの外乱に起因する不安定性を解決しました。ミリメートルオーダーまでの膜厚・層厚を0.01ミリメートルの分解能で自動測定する安定で使い勝手のよい膜厚測定器です。

*1 スーパーミネッセントダイオード(SLD)
発光ダイオード(LED)のように広いスペクトル幅と、レーザーダイオード(LD)の高出力性能を持ち合わせた発光素子

▶ 非接触、非破壊で測定ができます

光学系測定方法を使用しているため、被測定物に測定部が接触することはありません。したがって、直接接触すると状態の変化するような物も測定可能です。

▶ 微小部分の測定ができます

照射面積の狭い光線を使用することで、測定箇所が小さくても計測できます。

▶ 離れた場所の測定物の測定ができます

光伝搬路の光ファイバー化により被測定物が測定器から離れた場所にあっても、測定部だけを測定箇所に設置することで、遠隔地からの測定ができます。

▶ メンテナンスが容易です

光伝搬路の光ファイバー化により、調整箇所を少なくしました。

>> 用途

- ・真珠層 ・歯のエナメル層 ・塗装膜 ・コーティング膜
- ・半導体酸化膜 ・各種フィルム厚 ・各種ガラス厚 他